

## 장비사용료 기준

1. 서비스 수수료 할인율 : 연구원 입주기관 10% 할인

2. 장비별 서비스 수수료

관련부서 : 스마트전자부품연구센터

Equipment	단위	요금(단위:원)		비고	
		본인수행	공정의뢰		
Mask Aligner	원/시간	-	236,000		
Wet Cleaner	원/시간	-	150,000		
Coater/Developer	원/시간	-	236,000		
Etcher/Stripper	원/시간	-	178,000		
Slit coater	원/시간	159,000	198,000		
Inkjet Printer(PLED)	원/시간	206,000	257,000		
Screen Printer	원/시간	112,000	139,000		
Inkjet Printer(lab)	원/시간	71,000	87,000		
Gravure Offset(IL)	원/시간	112,000	139,000		
Reverse Offset	원/시간	112,000	140,000		
UV Cleaner	원/시간	-	53,000	공정 package 지원	
항온건조기	원/시간	-	49,000	공정 package 지원	
고온진공건조기	원/시간	-	52,000	공정 package 지원	
Organic Evaporator	원/시간	-	414,000		
단위 공정	Metal	원/시간	-	126,000	
	Spin Coater	원/시간	32,000	39,000	
	Full Color	원/시간	-	-	별도 협의

Equipment		단위	요율(단위:원)		비고
			본인수행	공정의뢰	
Multi Layer Thin Film Cluster		원/시간	-	679,000	
단위 공정	PECVD	원/Glass	-	181,000	1.기본두께:3,000 Å (SiO <sub>2</sub> ) 2.추가:50,000원/1,000 Å (SiN <sub>x</sub> )
	RIE	원/Glass	-	216,000	1.기본두께:3,000 Å (SiO <sub>2</sub> & SiN <sub>x</sub> ) 2.추가:61,000원/1,000 Å (SiO <sub>2</sub> & SiN <sub>x</sub> )
	Evaporator	원/Glass	-	181,000	
	Sputter	원/Glass	-	163,000	1.기본두께:3,000 Å (Mo & Al) 2.추가:50,000원/1,000 Å (Mo & Al) 3.기본:1500 Å (ITO) 4.추가:50,000원/500 Å (ITO) 5.기본 : 1000 Å (Ag) 6.추가:50,000원/500 Å (Ag, 재료비 별도) 7.상기 재료 이외는 별도 협의
	RTA	원/시간	-	135,000	
저온 스퍼터 - ICP RIE 복합장비		원/시간	-	510,000	
단위 공정	ICP RIE	원/Glass	-	244,000	1.기본두께:3,000 Å (SiO <sub>2</sub> & SiN <sub>x</sub> ) 2.추가:61,000원/1,000 Å (SiO <sub>2</sub> & SiN <sub>x</sub> )
	저온 스퍼터	원/Glass	-	185,000	1.기본두께:3,000 Å (Mo) 2.추가:50,000원/1,000 Å (Mo) 3.기본:1500 Å (ITO) 4.추가:75,000원/500 Å (ITO) 5.상기 재료 이외는 별도 협의
CBD (Chemical Bath Deposition)		원/시간	73,000	91,000	
Scriber		원/시간	72,000	90,000	
Breaker		원/시간	72,000	90,000	
OLED Lighting 측정		원/시간	73,000	91,000	
열화상 카메라		원/시간	51,000	63,000	
3D Surface Profiler		원/시간	80,000	99,000	
플라즈마 원자층 증착기 (PEALD)		원/시간	80,000	100,000	10nm 기준, 이상 시 ×n배
Thickness Measurement		원/시간	80,000	99,000	Visible Light Transmittance
Optical Micro Scope(CCD)		원/시간	56,000	70,000	
Optical Micro Scope(UV)		원/시간	56,000	70,000	

Equipment	단위	요금(단위:원)		비고
		본인수행	공정의뢰	
분산 안정성 측정기	원/시간	56,000	70,000	
2D Surface Profiler	원/시간	66,000	82,000	
Life Time Measurement	원/Channel ·Week	59,000	73,000	
4-Point Probe	원/시간	67,000	83,000	
IVL Measurement	원/시간	66,000	82,000	
Contact Angle	원/시간	46,000	57,000	
Particle Size Analyzer	원/시간	45,000	56,000	
Viscometer	원/시간	38,000	47,000	
임피던스 분석기 (Impedance Analyzer)	원/시간	48,000	59,000	
다목적 다이분더	원/시간	97,000	121,000	